## **RF SOURCE OF COMPACT ERL (cERL) IN KEK**

S. Fukuda<sup>1</sup>, T. Miura, M. Akemoto, H. Katagiri, T. Shidara, T. Takenaka, H. Nakajima, K. Nakao, H. Honma, S. Matsumoto, T. Matsumoto, H. Matsushita, S. Michizono, Y. Yano, M. Yoshida,

S. Kazakov, T. Takahashi, S. Sakanaka, KEK, Ibaraki, 305-0801, Japan

#### Abstract

ERL of 5GeV energy is a future plan in KEK and in order to study the technical feasibility, construction of a compact ERL machine (cERL) is considered. Beam energy and current of cERL are 245MeV and 100mA, respectively. As 1.3 GHz frequency and super conducting cavity are chosen for the RF system, similar technology with KEK STF is employed. In this report, recent RF source development of cERL is described. From 2008, KEK started the preparation of cERL and one RF unit of injector linac is introduced in this fiscal year. We will start coupler test of the injector linac cavity in PF preparation hall. Layout of the east counter hall, where cERL is constructed, is progressed and shown in this report.

# **KEKにおけるcERLシステムのRF**源

### 1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では将来計 画として5GeVのERLを検討している。この種の加 速器は技術的に難しい要素が多いために、当面コン パクトERL(cERL)という試験機を作り技術的な検討 とERL原理の実証性を探ることになった。cERL加 速器のビームエネルギーは35~245MeV、平均電流 が10~100mA、規格化エミッタンスが0.1~1mm・ mrad等といったパラメータを有する[1]。このERL加 速器では非常に高い安定度(0.01%rms振幅、0.01度 rms位相)が要求される。RF源の使用周波数は1.3GHz で、加速空洞としては超電導空洞を用いるために KEKで進められているILC-STFと共通の技術要素が ある。空洞を含めたRF関係はSTFと重複したメン バーが参加している。検討は2007年ごろから進めら れ、2009年始めにCDR[1]が出版された。

cERLのRF源の構成はCDRによれば以下の通りで ある。入射器ライナックはビーム電流10mAを 5MeV迄加速する。必要なRF電力は500kWである。 2セル空洞からなるクライオモジュール3台からなり、 それぞれ120kW、190kW、190kWのRF電力が必要で ある。安定度はcERLでは本番よりゆるい安定度 (0.1%rms振幅、0.1度rms位相)が要求されているが、



図1 cERLにおけるRF源のレイアウト

<sup>1</sup> E-mail: shigeki.fukuda@kek.jp

それでもLLRFのフィードバックによる安定化が必 須である。このフィードバックはRF源の入出力特 性が線形的な所を利用して行われる。この動作点を、 RF源の印加電圧における飽和出力の75%に設定す ると、RF源に要求される必要な飽和出力は250kW、 更にマージンを含めて300kW程度の電力が必要と決 めた。これはクライストロンを用いて行うが、これ を満足するものは市販されていないので、新たに開 発することとした。

主ライナックは9セル空洞4台を当面考え、その RF源としては、IOT(別名クライストロード)を使用 する予定である。25kW~30kW出力のものを検討中 である。RF源の構成は図1に示した。本報告ではこ のcERLのRF源に関する開発状況を説明する。

### 2.入射器用RF源の構成と現状

#### 2.1 300kW クライストロン系

3台の大電力系空洞は2セル空洞からなるが電力が 大きいためにカップラーを2つにして半分ずつの電 力を1台のカップラーが受け持つ。空洞からの反射 を考慮してサーキュレータが必要であるがこれも カップラー1台に対応して1台のサーキュレータを考 える。これらを考慮すると1空洞に対するRF源の構 成は図2のようになる。図2にはRF源のブロックダ イアグラムと現在考えている構成を3次元で示した ものを同時に示した。

以上から入射器用RF源で開発すべきものは、 300kW・CWクライストロン、このクライストロン 用DC電源、大電力サーキュレータ(定格は150kW)、 LLRFシステムである。LLRFについては別の節で述 べるのでここではHLRFの3つのコンポーネントの開 発状況について述べる。300kWクライストロンの仕 様については表1に示した通りである。設計は昨年 度完了し昨年度中に構造体部分を製作した。今年度 は真空管化とプロセシングを行い9月には納入予定



図2:入射器RF源の構成。左図はブロック図。右 図は現在想定している3次元配置図。

である。直流電源の仕様は最大電圧52kV、出力電 流11A、リップル0.5%(p-p)(リップル等の安定度は 本来であれば0.3%(p-p)が必要)である。設置場所の 制限等から1筐体に主要電源構成部が収まる構造と なっている。入力電圧は紆余曲折したが6.6kVとし、 施設側にVCBを有している。電源への高調波フィル ターについての仕様を詰めている。回路の方式につ いては特に指定しなかったがサイリスター位相制御 方式である。クライストロン電子銃での放電時の許 容注入エネルギーは20J以下という仕様で、放電時 にはクローバーではなく速やかにIGBTを遮断する 方式を取る予定である。2009年7月に入札が行われ IDX社が受注をしている。2010年3月納入予定であ る。

1台のサーキュレータの電力仕様は透過電力150k Wである。安価でコンパクトな3端子型(Y型)を 開発することとした。電力が大きいのでフェライト 部分が4段構造にした設計となっている。但しフェ ライト部の発熱条件の制限から、100kW時は任意の 位相での全反射に対してOKであるが150kW全反射 時は速やかに(数秒以内)インターロックでRFを停止 するとしている。導波管系のレイアウトはやはり図 2に示されているが最終案ではない。CWなので導波 管の発熱が無視できず水冷管付き導波管を使用する。 フレキシブル導波管も熱冷却を考慮したものを導入 する。

表1 300kW クライストロンの仕様

	電子銃仕様:	
	■ パービアンス	0.89±0.9 µ A/V <sup>2/3</sup>
	■ カソード(ビーム)電圧	52kV(Max)
	■ カソード(ビーム)電流	11A(Max)
	カソード	バリウム含浸型カソード
	■ 電極構造	2極管
	本体仕様	
	■ 周波数	1300MHz
	出力電力(飽和出力)	270kW以上(目標300kW)
	■ 空洞数	5
	■ 飽和出力時効率	50%以上(目標60%)
	■ 飽和時利得	37dB以上
	■ コレクター損失	500kW(Max)
	■ コレクター冷却方式	水冷
-	機械的仕様:アクセサリー仕様	
780	■ クライストロン配置姿勢	縦置き
	■ 架台	電子銃部分絶縁油に浸す

#### 2.2 バンチャー部のRF系

入射部にはバンチャーが必要である。CDRでは特 に明記されていなかったが、離調時の動作も含める と15~20kW程度のRF源が必要である。既に30kW クラスのCWクライストロンがcERL用に開発されて いたが、効率が良いことからIOT(Inductive Output Tube又はクライストロード)の使用が検討されてい る。IOTは利得が悪いので前段アンプを含めるとコ スト的にはクライストロンと同等であるが本番用 ERLで使用する同クラスのRF源は台数が多いので効 率が良いことはIOTのメリットである。今現在IOT の出力としては1.3GHzで最大の30kWクラスのCPI 社・IOTを候補として考えている。このIOT用の 50kVA電源は2009年夏の入札が予定されている。こ の電源は30kWクライストロンにも使用できる。

バンチャー空洞に使用されるサーキュレータは STFで用いられているロシアフェライト社の5 MW・4端子型(位相差形)サーキュレータを考えてい る。これは平均電力40-80kWで使用可能で比較的安 価である。

## 3. 主ライナックのRF系

主ライナック系のRF源に関してはまだ具体的な 予算措置がなされていないので具体的な仕事は行わ れていない。しかしながらRF電力の定格などは入 射部バンチャーのRF源と同等であるので同じ構成 を考えている。30kWのIOT、直流電源、サーキュ レータなどは主ライナックのRF源の先行的な技術 的な役割を占めるものである。

#### 4. LLRF

LLRFの全体の構成は図3に示した通りである。デジ タル制御系、高周波増幅系、高周波モニター系、 チューナ制御系、機器安全系(MPS)からなるが今 現在、当面の試験のために整備しているのは高周波 増幅系、モニター系、MPSである。MPSはJ-Parcと 同じものを使用し、速いアークの検出はφ0.6mmの 光ファイバーとフォトダイオード/光電子増倍管を 使用している。デジタル制御系は2009年度に制御用 ボードを製作する。筐体には電話通信業界で幅広く



使用されているAMCモジュールを予定している。 チューナ制御系も上記デジタルボードを使用したデ ジタル制御を検討中である。

## 5. 入射部カップラー用試験ベンチ

入射部空洞に使用される大電力空洞用カップラー は6台あるが2010年には発注されるのでその前に評 価をすることが必須である。そのためにKEKのPF実 験準備等に暫定的なカプラー試験ベンチを2009年秋 から展開しようとしている。300kWクライストロン はこの予定に合わせて納入されるが、直流電源は間 に合わない。一方でPFの200kW・クライストロン用 の予備電源があるのでそれを再利用してこの試験ベ ンチで使用することが提案された。現在図4にある ような配置で入射部カップラー試験ベンチをPF実験 棟へ展開する準備を行っている。インターロック、 暫定的なLLRF(フィードバックは無し)等を作り9 月中旬からの試験開始に向けて準備を行っている。



図4: PF実験準備等におけるカップラー試験 ベンチのレイアウト

## 6. CERLの東カウンターホールでの展開

cERLの実証器を展開する場所はKEKの東カウン ターホールと決まり、シールドの撤去、床整備など 行われ一部冷凍機の設置工事などが始まった。ここ でのRF関係の展開するプランを検討中である。図5 にcERLの全体のレイアウトを示した。赤く塗りつ ぶされた場所がRF関係のスペースである。特に入 射部(青丸の部分)については具体的な機器の配置プ ランの検討が進んでおり、3次元の配置図は図6に示 された通りである。電源、クライストロン、導波管 系の配置が大体決まり又LLRFの機器をなるべく近 くに置くために中2階構造にし、古いプレハブを利 用してLLRF室、RF測定室などに使用する。又プレ ハブの横には将来のカップラー試験ベンチ用空間も 確保した。入射部は非常に狭いところにカップラー、 低温配管がひしめくので合理的な配置を検討すべき であるがまだ完成していない。又バンチャー関係の RF源を近くに配置したいがその合意はまだ出来て



図5: 東カウンターホールにおけるcERL実証機 のレイアウト

いない。RF源の具体的な設置は2010年3月末から始まる予定である。



図6:東カウンターホールでのRF源(特に入射 器)のレイアウト

### 7. 今後の予定

HLRF関係は300 k W・クライストロンの最初の評価(150 k W-200 k W)を9月に行い、その後カップ ラー試験を10-11月に行う。東カウンターホールでは(2010年4月より300kWクライストロン試験(電源、 立体回路系、LLRFを含む)が始まる予定である。 30 k W・バンチャー系RF源1式の試験は2010年4月よりAR南棟で展開される。

LLRF関係はPF実験準備棟でのカプラーテストス タンドのための準備が進行中でアナログ・安全系を 使ったものが9月より試験可能である。デジタル フィードバック系は2009年度に試作、2010年度に評 価の予定で進んでいる。

#### 参考文献

[1] 羽島良一、中村典雄、坂中章悟、小林幸則, "コンパ クトERLの設計研究", KEK Report 2007-7,2008.